



Dipl.-Ing. Willi Muhsfeldt, Über dem Dorfe 32, 07751 Jena

Einladung

Wir laden ein zu einem Vortrag über das Thema:

Wie bessere Auflösung die Größe und Komplexität in der Herstellung von Lithografie-Optiken treibt — Technik und patentrechtlicher Schutz

Es spricht Dr. Christoph Zaczek (ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology)

Die Veranstaltung findet statt am

Donnerstag, 30. Januar 2025, 18.00 Uhr s.t.

im Uni-Campus am Ernst-Abbe-Platz, Carl-Zeiß-Straße 3, 1. OG, Hörsaal 6.

Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena, dem Deutschen Patent- und Markenamt - Dienststelle Jena und dem Verband VPP (Verband für Fachleute des gewerblichen Rechtsschutzes).

Inhalt des Vortrags:

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde der weltweit erste EUV-Scanner für die Lithografie mit hoher numerischer Apertur (NA) an einen Halbleiterhersteller ausgeliefert, der eine Auflösung von 8 nm in der Chip-Produktion ermöglicht. Die Optik, die eine solche Auflösung ermöglicht, besteht aus asphärischen Spiegeln mit einer Größe von bis zu einem Meter und wird in Serie mit einer Präzision von weniger als 100 Picometern hergestellt. In diesem Vortrag werden die Anforderungen, Herausforderungen und die Leistungsfähigkeit von Optikprozessen für Lithografie-Optiken von DUV bis EUV umfassend diskutiert. Auch auf den patentrechtlichen Schutz der Innovation wird eingegangen.

Wissenschaftliche Biografie des Vortragenden:

Christoph Zaczek ist Head of Architecture Process Development Optics bei Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing und seit 2019 ZEISS Fellow.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Optikprozess-Technologie bei ZEISS entwirft und entwickelt er und sein Team Prozessarchitekturen für langlebige, hochpräzise Lithografie-Optiken und deckt dabei alle Aspekte von der Konturierung bis zur Beschichtung ab. Er erhielt seinen Masterabschluss in Physik von der Portland State University im Jahr 1995, sein Diplom von der Universität Stuttgart im Jahr 1998 und seine Promotion von der Universität Ulm im Jahr 2005.

i.A. Karl-Heinz Donnerhacke

Karl-Heinz Donnerhacke